台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 108.08.28 文
檔號：108541

財團法人工業技術研究院　函

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號
承辦人：方仁祥
電話：03-5914466
傳真：03-5820466
E-mail：dennis_fang@itri.org.tw

108001553001

241 三重區重新路五段 609 巷 6 號 3 樓之 3

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會
發文日期：中華民國 108 年 08 月 27 日
發文字號：工研轉字第 1080015530 號
速別：普通件
密等：無
附件：如文

主旨：有關本院「光學同調斷層掃描相關技術暨專利專屬授權案」，敬請轉知 貴會會員等相關廠商重要資訊，把握機會參與本活動，請 查照。

說明：

一、為提昇國內廠商智慧財產權之能量，本院將辦理光學同調斷層掃描相關技術暨專利組合，包含專利(2 案 6 件)及技術 1 件之專屬授權公開招標活動。（詳如附件）。

二、有關本活動詳細資訊，請參考下列網站公告：

（一）工研院研發成果公告網站
（https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1）

（二）台灣技術交易資訊網
（https://www.twtm.com.tw/Web/news/trans.aspx）。

三、本案截標日為 108 年 9 月 17 日，開標日為 108 年 9 月 18 日。

四、公開說明會：

（一）舉辦時間：民國（下同）108 年 9 月 10 日下午 14 時至 15 時。

（二）舉辦地點：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110-1 室。

（三）報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 108 年 9 月 9 日中午 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（主旨請註明「光學同調斷層掃描相關技術暨專利專屬授權案公開說明會報名」，並於內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。

五、聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心

方先生

電話：(03)591-4466

傳真：(03)582-8639

電子信箱：dennis_fang@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

院長 劉文雄

依權責劃分規定授權業務主管決行

工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

108 年度工研院
光學同調斷層掃描相關技術暨專利專屬授權案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可累積強有力的智慧財產權能量，並可藉此提升競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質技術暨專利，以專屬授權之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立，從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、授權標的：

本專屬授權案包含光學同調斷層掃描相關技術暨專利組合，包含技術 1 件(以下簡稱「技術標的」)及專利 2 案 6 件(以下簡稱「專利標的」)。「技術標的」及「專利標的」以下合稱「授權標的」。

「授權標的」相關資訊詳如附件或請參考台灣技術交易資訊網（https://www.twtm.com.tw/Web/index.aspx）、及工研院研發成果公告網站（ https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1）。

四、公開說明會與領標：

1. 公開說明會將於民國（下同）108 年 9 月 10 日 14 時整於工研院中興院區 51 館 110-1 室舉辦。
2. 公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 108 年 9 月 9 日中午 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「光學同調斷層掃描相關技術暨專利專屬授權案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十二、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 108 年 9 月 9 日下午 5 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。
3. 自本標案公告日起至截標日(即：108 年 9 月 17 日下午 5 時整)止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

1. 採通訊或親送方式投標。投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，

加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同押標金、公司設立證明文件（如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本）、廠商基本資料表及商業營運計畫書一式 8 份(以下統稱「投標文件」)，裝入信封密封之，並在信封上註明「光學同調斷層掃描相關技術暨專利專屬授權案投標」，於截標日 108 年 9 月 17 日下午 5 時整（含）前（以送達收據為憑）掛號寄達或親送至：

31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

工研院技轉法律中心 方先生 收

2. 本標案採「技術暨專利組合」方式投標，不分開投標/開標。
3. 本標案不允許共同投標或重複投標。
4. 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。
5. 投標廠商於投標時，不得附加任何成交條件。

六、押標金：

1. 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。
2. 押標金應以現金、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
3. 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於開標後掛號無息寄回投標廠商。

七、商業營運計畫書應包含以下事項：

1. 公司簡介（評審比重 10%）
2. 公司研發能力（40%）
3. 公司營運規劃（40%）
4. 其他（10%）（例如：對於授權標的之運用規劃…等）

八、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

1. 投標時間截止後之投標。
2. 開標前業已公告停止本標案交易程序。
3. 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
4. 投標單附加任何成交條件者。
5. 投標文件之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
6. 投標文件有所缺漏者。但押標金不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於決標前未能補足者，其投標為無效。

九、決標方法：

1. 開標日為 108 年 9 月 18 日(開標時間及地點另行通知投標廠商)。
2. 得標與否由工研院開標審議委員會會議決定之。

3. 開標時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、廠商基本資料表、商業營運計畫書進行形式審查。
4. 投標廠商通過形式審查者，由工研院開標審議委員會議就商業營運計畫書進行審查評比，投標廠商應蒞會就商業營運計畫書進行簡報說明及答詢，並應自行備妥簡報電子檔及書面文件。
5. 工研院開標審議委員會議將以商業營運計畫書總評比分數高低順序進行開標，以投標金額高於底價者得標。有二家（含）以上投標廠商總評比分數相同且投標金額均高於底價時，以總價高者得標；有二(含)以上投標廠商總評比分數相同、投標金額均高於底價，且總價相同者，由「工研院」現場抽籤決之。
6. 開標時將請律師到場監標。
7. 開標後將個別通知投標廠商開標結果（不公告得標廠商）。
8. 對於流標、廢標或無效投標之「授權標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。

十、契約事項：

1. 得標廠商應於接獲得標通知起三十個工作天內，與工研院簽訂「專屬授權契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「專屬授權契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「專屬授權契約書」之權利。
2. 得標廠商如屆期未與工研院簽訂「專屬授權契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
3. 得標廠商與簽訂「專屬授權契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
4. 得標廠商就「授權標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施等規定）。前述法令變動時，亦同。
5. 於「專屬授權契約書」生效，且得標廠商依約如期支付授權費用之前提下，工研院同意授予得標廠商使用、實施、運用「授權標的」或用以製造相關產品之權利。非經工研院事前書面同意，得標廠商不得於中華民國管轄區域（係指台、澎、金、馬，下同）外使用、實施、運用「授權標的」或用以製造相關產品。得標廠商就「授權標的」於符合下列全部條件時，可非專屬再授權他人，惟再授權廠商違反本公告、「專屬授權契約書」約定時，視為得標廠商違反「專屬授權契約書」：
(1)應事前將各該再授權廠商之名稱、授權範圍、價金及付款時程等細節以書面通知工研院，並經工研院事前書面同意；

(2)依照與工研院之「專屬授權契約書」約定，將再授權所收取之金額之一定比例支付工研院；

(3)以書面約束再授權廠商遵守本公告、「專屬授權契約書」中得標廠商所應遵守之一切約定；如再授權廠商違反前述約定，工研院得直接對該再授權廠商主張權利。

6. 得標廠商取得「授權標的」之專屬授權應支付工研院授權費用及授權期間之「授權標的」專利申請維護等相關費用，授權費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
7. 得標廠商簽署「專屬授權契約書」且生效時，本標案簽約保證金移充為「專屬授權契約書」之授權費用。
8. 「專屬授權契約書」自其所載生效日起生效。「技術標的」之授權期間自「專屬授權契約書」生效日起算二十年為止，「專利標的」之授權期間自「專屬授權契約書」生效日起至專利期間屆滿為止。
9. 得標廠商同意經濟部及工研院就「授權標的」於專屬授權期間內，享有無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利。
10 得標廠商應就「授權標的」之一部或全部，承受於「專屬授權契約書」生效前：1.工研院已與第三人簽訂之授權契約；2.工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；及 3.工研院已承諾不會對特定人及特定產品行使專利權。
11. 得標廠商同意並承認，「專屬授權契約書」僅為工研院同意授權「授權標的」予得標廠商。工研院亦僅依本標案公告日之「授權標的」現狀辦理本標案並交付得標廠商，工研院不擔保「授權標的」之尚在申請中之專利可獲證，或可依原始申請範圍獲證，或已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「授權標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「授權標的」所製造產品之產品責任。「專利標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「授權標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。
12. 得標廠商應盡力進行產品開發工作，得標廠商未於合理期間內運用「授權標的」，工研院得以書面終止「專屬授權契約書」或轉為非專屬授權，且工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。
13. 得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得終止「專屬授權契約書」，並得將「授權標的」授權他人實施，或於必要時將「授

權標的」收歸國有：

(1)得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「授權標的」，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。

(2)得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「授權標的」者。

(3)為增進國家重大利益者。

有前項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

14.基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對依中華民國法律設立之法人或中華民國國民就「授權標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院。如得標廠商於「專屬授權契約書」生效後對第三人就「授權標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、程序或訴訟，工研院無參與或提供得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務，得標廠商前述行為、程序或訴訟均與工研院無涉。

15.得標廠商於簽訂「專屬授權契約書」後因股權變動而產生或增加陸、港、澳投資時，應於事實發生後 30 日內以書面通知工研院，工研院若認為有違反政府法令規定或損及我國整體產業及技術發展時，得以書面敘明理由通知得標廠商後終止、解除契約或另議新約。

十一、領標方式：

有意投標者，請與工研院「技轉法律中心」聯絡人（請詳十二、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十二、注意事項：

1.投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本公告、「授權標的」、投標單及相關資訊之內容。本標案公告為「專屬授權契約書」之一部分。各該內容如有不清楚或牴觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

2.於「專屬授權契約書」有效期間內，如「授權標的」有讓與之需求時，在符合工研院內部程序及政府法令規定前提下，得標廠商具有優先受讓之資格，工研院得逕洽得標廠商辦理相關讓與程序。

十三、聯絡方式：

聯絡人：工研院「技轉法律中心」 方先生

電話：(03) 591-4466，傳真：(03) 582-0466

電子信箱：dennis_fang@itri.org.tw

地址：31040 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

附件：

本次專屬授權「技術暨專利組合」如下：

一、 技術清單

編號	技術名稱	技資名稱	可應用範圍
1	OCT 膚質影像模型	OCT 膚質影像模型開發計畫結案報告 影像導引診療系統關鍵技術開發整備報告	應用於抗老,再生醫學與健康預防醫學等功能性量測

二、 專利清單

案次	件編號	件次	專利名稱	國家	申請號/專利證號	狀態	專利起期	專利迄期	委辦單位
1	P56050020TW	1	生物組織光學檢測探頭	中華民國	I652467	獲證	20190301	20370911	經濟部技術處
	P56050020US	2	生物組織光學檢測探頭	美國	15/717,116	審查中	審查中	審查中	經濟部技術處
	P56050020CN	3	生物組織光學檢測探頭	中國大陸	201710897817.7	審查中	審查中	審查中	經濟部技術處
2	P56040022TW	4	皮膚組織估測方法及應用其之系統	中華民國	I584225	獲證	20170521	20361124	經濟部技術處
	P56040022US	5	皮膚組織估測方法及應用其之系統	美國	10,127,661	獲證	20181113	20370406	經濟部技術處
	P56040022CN	6	皮膚組織估測方法及應用其之系統	中國大陸	201611169461.7	審查中	審查中	審查中	經濟部技術處